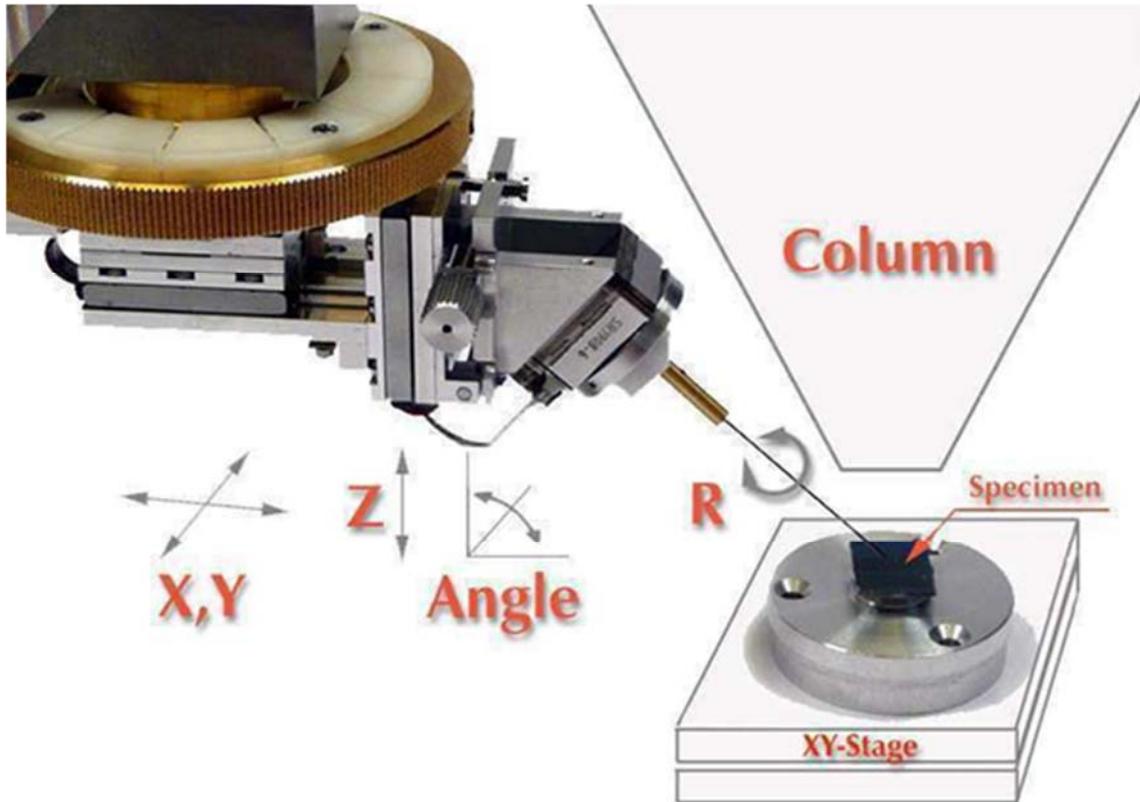


透射样品取样设备 TEM-lift-out / 纳米操作手臂



高精度 X- Y-Z- R- (T)部件

如图所见的产品可以有很多应用。特别是用于制备 TEM 透射样品以及进行各类纳米级操纵。

行程范围：X= 20mm，Y =20mm 时，Z =5mm，R =无限制，T = $\pm 10^\circ$ mm（手动倾斜变化）。可以根据要求定制更大的行程范围或要求更多运动轴向方向。

由于安装有线性传感器，所以操作手臂具体的位置随时都可以知道。这提供了巨大的便利控制探针到达所想观察的兴趣点。位置信息可以进一步被存储并且再次调用。

一旦样品和针尖之间的高度已知，探针接近一个或者多个兴趣点时就会完成的非常安全和容易。

由于采用了正交的交叉轴，机械结构比较坚固，部件不会老化劳损。

Materials	Aluminium, Stainless Steel, Ceramics
Dimensions in mm (L x B x H)	~ 40 x 54 x 35 (cross table) Weight: ~100g.
Coverage in mm	20 x 20 x 20 (XYZ-Modul)
Positioning accuracy	< 100 nm
Movement resolution	< 1 nm
Speed range	1000 $\mu\text{m}/\text{sec}^*$. – 0,001 $\mu\text{m}/\text{sec}$.
Position measurement	Linear Encoder
Controller	Microprocessor controller, Joystick
Housing	Desktop box

